



KINTEK SOLUTION

Pacvd 목록

더 많은 카탈로그를 원하시면 저희에게 연락하세요 샘플 준비, 열 장비, 실험실 소모품 및 재료, 바이오화학 장비, 등

KINTEK SOLUTION

회사 프로필

>>> 회사 소개

Kintek Solution Ltd는 하나의 기술 지향 조직이며 팀원들은 과학적 연구 장비, 생화학 반응, 신소재 연구, 열처리, 진공 생성, 냉장과 같은 분야에서 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술과 혁신을 조사하는데 전념하고 있습니다. 그리고 석유 추출 장비.

지난 20년 동안 우리는 장비 연구 분야에서 풍부한 경험을 쌓았고 고객의 요구와 현실에 따라 장비와 솔루션을 모두 공급할 수 있으며 특정 작업 목적에 따라 많은 고객 맞춤형 장비를 개발했으며 우리는 아시아, 유럽, 북미 및 남미, 호주 및 뉴질랜드, 중동 및 아프리카와 같은 여러 국가의 많은 대학 및 기관에서 많은 성공적인 프로젝트를 진행하고 있습니다.

직업, 빠른 응답, 근면 및 성실은 고객 사이에서 건전한 평판을 얻는 팀 구성원의 작업 태도에 대한 놀라운 레이블입니다.

우리는 다양한 국가와 지역의 고객에게 서비스를 제공하고 가장 효율적이고 신뢰할 수 있는 기술을 함께 공유할 준비가 되어 있습니다!



액체 가스화기 Pecvd 장비가 장착된 슬라이드 Pecvd 관로

품목 번호: KT-PE12



소개

KT-PE12 슬라이드 PECVD 시스템: 넓은 전력 범위, 프로그래밍 가능한 온도 제어, 슬라이딩 시스템을 통한 빠른 가열/냉각, MFC 질량 흐름 제어 및 진공 펌프.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 용광로 모델 | KT-PE12-60 |
| 최대 온도 | 1200°C |
| 일정한 작업 온도 | 1100°C |
| 용광로 튜브 재료 | 고순도 석영 |
| 용광로 튜브 직경 | 60mm |
| 가열 영역 길이 | 1x450mm |
| 챔버 재질 | 일본 알루미늄나 섬유 |
| 발열체 | Cr2Al2Mo2 와이어 코일 |
| 가열 속도 | 0-20°C/분 |
| 열 커플 | 벌드인케이타입 |
| 온도 조절기 | 디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러 |
| 온도 조종 정확도 | ±1°C |
| 슬라이딩 거리 | 600mm |
| RF 플라즈마 장치 | |
| 출력 파워 | ± 1% 안정성으로 조정 가능한 5 -500W |
| RF 주파수 | 13.56MHz ±0.005% 안정성 |
| 반사력 | 최대 350W |
| 어울리는 | 자동적인 |
| 소음 | |
| 냉각 | 공기 냉각. |
| 가스 정밀 제어 장치 | |
| 유량계 | MFC 질량 유량계 |
| 가스 채널 | 4채널 |

| | |
|--------------|--|
| 유량 | MFC1: 0-5SCCM 산소 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2 |
| 선형성 | ±0.5%FS |
| 반복성 | ±0.2%FS |
| 파이프 라인 및 밸브 | 스테인레스 스틸 |
| 최대 작동 압력 | 0.45MPa |
| 유량계 컨트롤러 | 디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러 |
| 표준 진공 장치(옵션) | |
| 진공 펌프 | 로터리 베인 진공 펌프 |
| 펌프 유량 | 4L/S |
| 진공흡입구 | KF25 |
| 진공 게이지 | Pirani/Resistance 실리콘 진공 게이지 |
| 정격 진공 압력 | 10Pa |
| 고진공 유니트(옵션) | |
| 진공 펌프 | 로터리 베인 펌프 + 분자 펌프 |
| 펌프 유량 | 4L/S+110L/S |
| 진공흡입구 | KF25 |
| 진공 게이지 | 복합 진공 게이지 |
| 정격 진공 압력 | 6x10 ⁻⁵ Pa |

위의 사양 및 설정은 사용자 정의할 수 있습니다.

| 아니요. | 설명 | 수량 |
|------|------------|----|
| 1 | 노 | 1 |
| 2 | 석영관 | 1 |
| 삼 | 진공 플랜지 | 2 |
| 4 | 튜브 열 블록 | 2 |
| 5 | 튜브 열 블록 후크 | 1 |
| 6 | 내열장갑 | 1 |
| 7 | RF 플라즈마 소스 | 1 |
| 8 | 정확한 가스 제어 | 1 |
| 9 | 진공 장치 | 1 |
| 10 | 사용 설명서 | 1 |

경사 회전 플라즈마 강화 화학 증착(Pecvd) 관로 기계

품목 번호: KT-PE16



소개

정밀한 박막 증착을 위한 기울어진 회전식 PECVD 가열로를 소개합니다. 자동 매칭 소스, PID 프로그래밍 가능 온도 제어 및 고정밀 MFC 질량 유량계 제어를 즐기십시오. 안심할 수 있는 안전 기능이 내장되어 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 용광로 모델 | PE-1600-60 |
| 최대 온도 | 1600°C |
| 일정한 작업 온도 | 1550°C |
| 용광로 튜브 재료 | 고순도 Al2O3 튜브 |
| 용광로 튜브 직경 | 60mm |
| 가열 영역 길이 | 2x300mm |
| 챔버 재질 | 일본 알루미늄 세유 |
| 발열체 | 몰리브덴 디실리사이드 |
| 가열 속도 | 0-10°C/분 |
| 열 커플 | B타입 |
| 온도 조절기 | 디지털 PID 컨트롤러/터치스크린 PID 컨트롤러 |
| 온도 조종 정확도 | ±1°C |
| RF 플라즈마 장치 | |
| 출력 파워 | ± 1% 안정성으로 조정 가능한 5-500W |
| RF 주파수 | 13.56MHz ±0.005% 안정성 |
| 반사력 | 최대 350W |
| 어울리는 | 자동적 인 |
| 소음 | |
| 냉각 | 공기 냉각. |
| 가스 정밀 제어 장치 | |
| 유량계 | MFC 질량 유량계 |
| 가스 채널 | 4채널 |

| | |
|-----------------------------|--|
| 유량 | MFC1: 0-5SCCM 산소 MFC2: 0-20SCMCH4 MFC3: 0- 100SCCM H2 MFC4: 0-500 SCCM N2 |
| 선형성 | ±0.5%FS |
| 반복성 | ±0.2%FS |
| 파이프 라인 및 밸브 | 스테인레스 스틸 |
| 최대 작동 압력 | 0.45MPa |
| 유량계 컨트롤러 | 디지털 노브 컨트롤러/터치 스크린 컨트롤러 |
| 표준 진공 장치(옵션) | |
| 진공 펌프 | 로터리 베인 진공 펌프 |
| 펌프 유량 | 4L/S |
| 진공흡입구 | KF25 |
| 진공 게이지 | Pirani/Resistance 실리콘 진공 게이지 |
| 정격 진공 압력 | 10Pa |
| 고진공 유니트(옵션) | |
| 진공 펌프 | 로터리 베인 펌프 + 분자 펌프 |
| 펌프 유량 | 4L/S+110L/S |
| 진공흡입구 | KF25 |
| 진공 게이지 | 복합 진공 게이지 |
| 정격 진공 압력 | 6x10 ⁻⁵ Pa |
| 위의 사양 및 설정은 사용자 정의할 수 있습니다. | |

| 아니요. | 설명 | 수량 |
|------|------------|----|
| 1 | 노 | 1 |
| 2 | 석영관 | 1 |
| 삼 | 진공 플랜지 | 2 |
| 4 | 튜브 열 블록 | 2 |
| 5 | 튜브 열 블록 후크 | 1 |
| 6 | 내열장갑 | 1 |
| 7 | RF 플라즈마 소스 | 1 |
| 8 | 정확한 가스 제어 | 1 |
| 9 | 진공 장치 | 1 |
| 10 | 사용 설명서 | 1 |

플라즈마 강화 증발 증착 Pecvd 코팅기

품목 번호: KT-PED



소개

PECVD 코팅 장비로 코팅 공정을 업그레이드하십시오. LED, 전력 반도체, MEMS 등에 이상적입니다. 저온에서 고품질의 고체 필름을 증착합니다.

자세히 알아보기

| | | |
|---------|----------|--|
| 샘플 홀더 | 크기 | 1-6인치 |
| | 회전 속도 | 0-20rpm 조절 가능 |
| | 가열 온도 | ≤800°C |
| | 제어 정확도 | ±0.5°C SHIMADEN PID 컨트롤러 |
| 가스 퍼지 | 유량계 | 질량 유량계 컨트롤러(MFC) |
| | 채널 | 4채널 |
| | 냉각 방식 | 순환 수냉식 |
| 진공 챔버 | 챔버 크기 | Φ500mm X 550mm |
| | 전망대 | 배플이 있는 풀 뷰 포트 |
| | 챔버 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
| | 문 유형 | 전면 개방형 도어 |
| | 캡 재질 | 304 스테인레스 스틸 |
| | 진공 펌프 포트 | CF200 플랜지 |
| | 가스 입구 포트 | φ6 VCR 커넥터 |
| 플라즈마 파워 | 소스 전원 | DC 전원 또는 RF 전원 |
| | 커플링 모드 | 유도 결합 또는 플레이트 용량성 |
| | 출력 파워 | 500W~1000W |
| | 마이어스 전력 | 500v |
| 진공 펌프 | 사전 펌프 | 15L/S 바람개비 진공 펌프 |
| | 터보 펌프 포트 | CF150/CF200 620L/S-1600L/S |
| | 릴리프 포트 | KF25 |
| | 펌프 속도 | 바람개비 펌프: 15L/s, 터보 펌프: 1200l/s ~ 1600l/s |
| | 진공 정도 | ≤5×10 ⁻⁵ Pa |

진공 챔버

이온화/저항 진공 챔버/필름 챔버

| | | |
|----|-------|----------------------|
| 체계 | 전력 공급 | AC 220V /380 50Hz |
| | 정격 전력 | 5kW |
| | 치수 | 900mm X 820mm X870mm |
| | 무게 | 200kg |



Kintek Solution

본사: No.11 Changchun Road, Zhengzhou, China

